

Presse-Information

Datum: Juli 2020
Anlage:
Kennziffer: PR-0018-CPE-210720-MICR

Wenn aus Oberflächenmesstechnik Oberflächenqualität wird Die neue Generation optischer 3D-Messtechnik für Oberflächendetails

Gerade für Oberflächendetails wie Rauheit, Textur und Mikrostrukturen setzt Polytec neue Maßstäbe. Seit 1967 widmet sich Polytec dem Vertrieb, der Entwicklung und Herstellung von optischen Technologien. Diese Kontinuität und Innovationskraft spiegelt sich in der neuen optischen 3D-Oberflächenmesstechnik MicroView und MicroView+ wider, konzipiert, um bei Präzisionsmechanik und Funktionsoberflächen die Rauheit, Mikrostrukturen sowie die Leistungsfähigkeit von Dichtflächen zu untersuchen. Diese optischen, also berührungsfrei prüfenden Messinstrumente unterstützen die Qualitätskontrolle und Entwicklung bei der Einhaltung enger Fertigungstoleranzen und heben die Oberflächenanalyse auf ein neues Niveau anhand realer 3D-Messdaten.

Verlässlich, präzise, innovativ

MicroView und MicroView+ stellen die neueste Entwicklung an 3D-Profilometern dar. Im Farbmodus lassen sich Defekte besser lokalisieren und dokumentieren für eine differenziertere Oberflächenanalyse anhand farbiger Mikroskopbilder. Erfassen Sie selbst feinste Oberflächendetails mit einer Auflösung im Sub-Nanometerbereich.

Die CST Continuous Scanning Technologie erlaubt den erweiterten Verfahrensweg von 100 mm komplett als vertikalen Messbereich auszunutzen für eine kontinuierliche Erfassung der Höhendaten. Die Präzisions-Z-Achse bietet mehr Freiheiten beim Positionieren, beschleunigt die Messvorbereitungen und ist vorteilig in der Wartung.

Um das Messobjekt stets im Fokus zu haben, helfen Focus Finder und Focus Tracker zum automatisierten Repositionieren, was Zeit für den Messvorgang und Positionieren einspart. Mit dem voll motorisierten Zubehör für die präzise Positionierung in X, Y, Z sowie der Kipp-Neige-Plattform behält der Fokus Tracker stets den eingestellten Fokus und gewährleistet wiederholgenaue und reproduzierbare Messergebnisse ungeachtet der Messposition.

Da die unmittelbare Umgebung des Messgerätes für unterschiedliche Nutzer und Einsatzorte variiert, bietet das MicroView+ mit seinem modularen Konzept bewusst diverse Freiheitsgrade, um beispielsweise bis zu 370 mm hohe Proben aufnehmen zu können. Für automatisierte Fertigungskontrollen lässt sich der Messkopf auch direkt in die Produktionslinie integrieren.

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

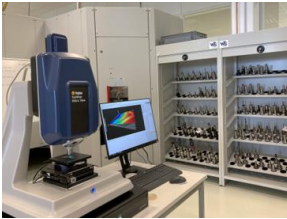
Zuständig bei Rückfragen
Christina Petzhold
Tel. 07243-604-3680

Presse-Information

Datum: Juli 2020

Anlage:

Kennziffer: PR-0018-CPE-210720-MICR



Die neuen optische 3D-Oberflächenmessgeräte TopMap MicroView und MicroView+ prüfen feinste Oberflächendetails wie Rauheit, Textur und Mikrostrukturen mit einer Auflösung im Nanometerbereich.



TopMap MicroView steht für die intuitive Oberflächencharakterisierung – egal ob im Messlabor oder in rauer Produktionsumgebung.



Mit neuer Präzisions-Z-Achse und CST Continuous Scanning Technology nutzt MicroView den gesamten vertikalen Verfahrweg komplett als Z-Messbereich aus, während Focus Finder und Focus Tracker stets den optimalen Fokuspunkt auf der Probe halten.

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Christina Petzhold
Tel. 07243-604-3680